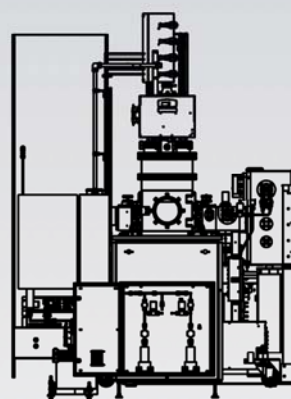
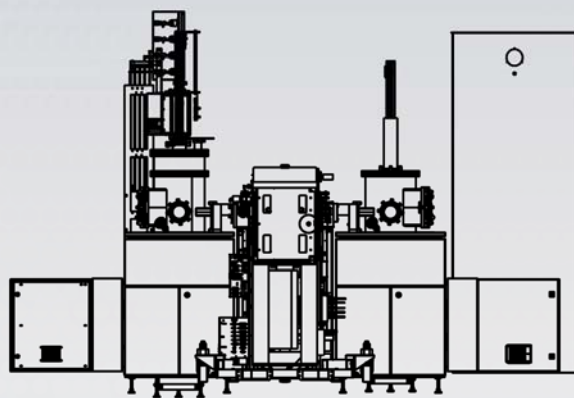
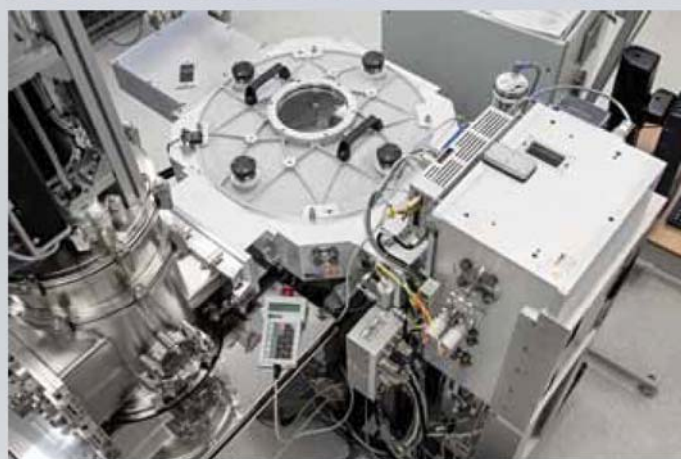


# Вакуумный кластерный инструмент PICOPLATFORM™ 200

Вакуумный кластерный инструмент PICOPLATFORM™ 200 продолжает идею уникальной масштабируемости и модульности всех инструментов ACO PICOSUN™. Кластер состоит из нескольких отдельных реакционных камер для ACO, интегрированных вокруг центрального модуля загрузки и контроля, основанного на вакуумном роботизированном манипуляторе Brooks MX400™. Кластер PICOPLATFORM™ 200 может быть оборудован загрузочным шлюзом для работы с одиночными подложками или автоматизированным покассетным загрузчиком, не нарушая при этом вакуумирование реакционных камер ACO. Также возможно подключение кластера к модулям, осуществляющим другие технологические процессы осаждения, и к системам предварительной обработки и пост-обработки.

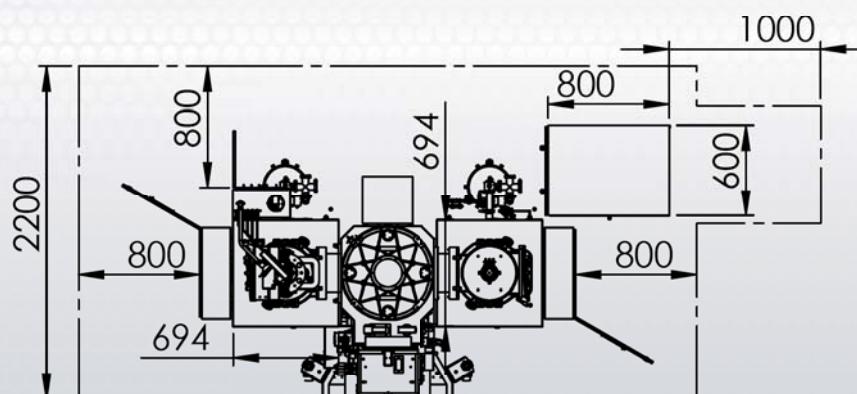
Огромная клиентская база инструментов ACO PICOSUN™ и работа в тесном сотрудничестве с лидирующим производителем вакуумных автоматизированных решений для полупроводниковой промышленности Brooks Automation гарантируют оптимальную производительность, техническую поддержку и эксплуатационную надежность систем ACO PICOSUN™. Беспримерная универсальность кластерных инструментов PICOPLATFORM™ удовлетворяет требованиям по производительности и автоматизации любой организации, выполняющей НИОКР или занимающейся производством.

Кластерная система PICOPLATFORM™ 200 совместима с инструментами ACO PICOSUN™ R-200 Advanced и она может быть использована как промежуточный инструмент для 100/200мм подложек.



**Технология ACO определяет будущее**

# PICOPATFORM™ 200 технические характеристики



- Размеры подложек: 100 мм, 150 мм, 200 мм
- Опции загрузки:
  - Загрузочный шлюз для одной подложки (полуавтоматический)
  - Автоматизированная покассетная загрузка до 25 подложек
- Дополнительный порт для интеграции оборудования с другим технологическим процессом посредством вакуумного роботизированного блока.
- Переходная камера с роботом, осуществляющим загрузку/разгрузку подложек
- Тонкая плёнка наносится на одну подложку за один раз
- Сенсоры подложки
- Встроенный юстировщик подложки
- Реакционная камера изолирована от атмосферы во время загрузки и разгрузки подложки
- Скорость утечки по гелию: макс.  $1.0 \times 10^{-8}$  торр•л/с He
- Совместимо с условиями чистого помещения
- Диапазон рабочих температур: от 10 °C до 30 °C
- Диапазон влажности в рабочем помещении: от 5% до 80 % (относительная, неконденсирующаяся)
- Электричество: однофазное 200-240 V, 10 A (обычно подключается посредством общей стойки кластерной системы)
- Размеры: 868 мм x 1147 мм x 1392.5 мм (Ш x Г x В)
- Вес: 708.5 кг
- Дополнительные опции:
  - Загрузчик с контейнером для полупроводниковых пластин со стандартным механическим интерфейсом (SMIF) для регулируемой среды;
  - Порты для дополнительных опций через тандем или основанной на кластерной системе Brooks MX700™;
  - Коммуникации SECS/GEM.

## Главный офис:

Picosun Oy, Tietotie 3,  
FI-02150 Espoo, Finland  
Tel: +358 50 321 1955  
Email: info@picosun.com  
Web: www.picosun.com

## Исследования и производство:

Picosun Oy, Masalantie 365,  
FI-02430 Masala, Finland  
к.т.н. Веселов Алексей Алексеевич  
телефон: +358 50 577 1588 или +7 921 760 9668  
e-mail: alexey.veselov@picosun.com

## Распространение и поддержка в России:

ООО "Евроинтех"  
140011, Московская область, г. Люберцы,  
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016  
Тел.: +7-(495)-749-45-78  
E-mail: sales@eurointech.ru  
<http://www.eurointech.ru/picosun>